

LX72シリーズ 測定項目

電気的特性 項目	IF	順方向電流測定	
	IR	逆方向電流測定	
	VF	順方向電圧測定	
	VR	逆方向電圧測定	
	hsVF	微小電流高速VF測定	
	KLVNH	ケルビンチェック：HOT側	
	KLVNC	ケルビンチェック：COM側	
	VLV	光量測定：電圧印加	
	VL	光量測定：電流印加	
	DVF3	Δ VF測定	
	THY	サイリスタ判定	
	SNP	スナップバック測定（高速サイリスタ測定）	
	POLV	極性判定：電圧印加電流測定	
	POL	極性判定：電流印加電圧測定	
	波長項目	LMD	主波長
		LMP	ピーク波長
LMX		xy色度座標 x	
LMY		xy色度座標 y	
WP		ピーク半値幅	
PUR		刺激純度	
KY		三刺激値 Y	
SUM		積分値	
SubP		サブピーク波長	
PkH		ピーク高さ	
HalfA		ピーク波長より短波長側の積分値	
2ndP		セカンドピーク波長	
2P/P		セカンドピークとピーク高さ比	
2PkH		セカンドピーク高さ	
LMC		セントロイド波長(重心波長)	
2LMC		セカンドセントロイド波長(重心波長)	
CW		中心波長	
SubCW		サブ中心波長	
2ndCW		セカンド中心波長	
Tc		相関色温度	
Duv		uv座標上の黒体軌跡からの外れ	
LMu		uv色度座標 u	
LMv		uv色度座標 v	
LMud		u'v'色度座標 u'	
LMvd		u'v'色度座標 v'	
Ra		平均演色評価数	
R1~R15		演色評価指数	
KX		三刺激値 X	
KZ		三刺激値 Z	
LumFlx		全光束	
RadPow		全放射束	
Qe		外部量子効率	
WAVE		スペクトル波形の保存	
SYNTH		スペクトル合成	
演算項目	ABS N	絶対値化	
	N+M	加算	
	N-M	減算	
	N*M	乗算	
	N/M	除算	
	REF	参照	
	MAX	大きい方の値	
	MIN	小さい方の値	
	LMXY	xy色度座標上でのx,yによるランク分類	
	LMUV	uv色度座標上でのu,vによるランク分類	
	LMUVD	u'v'色度座標上でのu',v'によるランク分類	
	eta	発光効率	

特殊項目	SigChk	外部機器制御項目
	TEMP.	温度測定
	JUMP	測定結果によって以降の項目の一部をSKIP
	DUTDIR	極性判定回数
	FSCHKH	コンタクト端子の外れ検知：HOT側
	FSCHKC	コンタクト端子の外れ検知：COM側
LD項目	VLSW	DC電流ステッパー-光量
	VFSW	DC電流ステッパー-順方向電圧
	VLP	パルス電流ステッパー-光量
	VFP	パルス電流ステッパー-順方向電圧
	VLSWP	パルス電流ステッパー-光量
	VFSWP	パルス電流ステッパー-順方向電圧
LD演算項目	Iop	指定光出力時の動作電流
	Vop	指定光出力時の動作電圧
	Eta	微分効率
	Ln	ステップ間傾き
	Pmax	PO最大時のPower値
	Vfmax	PO最大時の電圧値
	Imax	PO最大時の電流値
	Ith	指定した2点 (P1,P2) 間のデータから、最小二乗法による直線近似係数a,b
	Vth	Ithに対応するVF値
	Pe	自然放光出力
	Kink1	ILカーブの相関係数
	Kink2	キンク率：リニアリティ
	Kink3	キンク率2：落ち込み
	Kink4	立ち上がりキンク
Rd	I1-I2区間のLSM	
LdPow	光量指定でVF測定	
FFP項目	FFP	半導体レーザーのビーム拡がり (Far Field Pattern)
	HIAX	ビーム広がり角(平行)
	HIAY	ビーム広がり角(垂直)
	RAMAX	放射光軸ずれ角(平行)
	RAMAY	放射光軸ずれ角(垂直)
	Rpv2X	遠視野像リップル(FFP Ripple) Peakとの比較
	Rpv2Y	遠視野像リップル(FFP Ripple) Peakとの比較
	Rpv3X	遠視野像リップル(FFP Ripple) フィッティング値の比較
Rpv3Y	遠視野像リップル(FFP Ripple) フィッティング値の比較	
偏光測定項目	PLZ	偏光測定
	PLR	偏光比(Polarization Ratio)
	PLA	偏光角(Polarization Angle)
	PER	偏光消光比(Polarization Extinction Ratio)
	ZN	方位角(azimuth)